

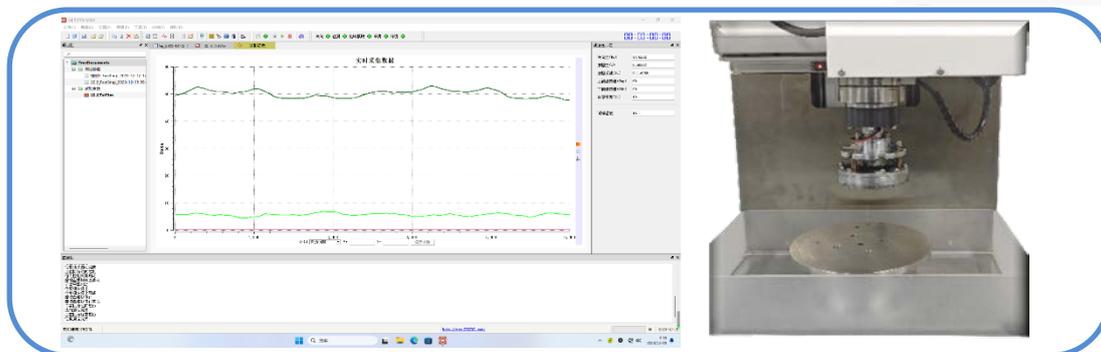
M110 桌面式抛光摩擦试验机

NBIT FTM M110 是一款由南京神源生智能科技有限公司研制的桌面式晶圆打磨抛光设备，具备横向、纵向及上下摩擦副旋转的四轴联动运动控制功能，采用电动伺服闭环控制模式，可精确控制法向加载力，并同步原位获取摩擦力，得到摩擦系数。

M110 可用于晶圆类产品的打磨抛光，也可用以开展摩擦学实验。

主要特点

- ◇ 电动伺服控制四轴联动运动模式，上下试样同时旋转，可用于打磨抛光也可用于摩擦学实验
- ◇ 电动伺服闭环控制，精确控制法向力
- ◇ 配备液体池，可用于液体环境抛光，也可用于浸泡式润滑摩擦实验
- ◇ 试验机专用多维力传感器，同步原位检测加载力及摩擦力
- ◇ 配备温度传感器，实时获取试样温度数据
- ◇ 可在线导出实验报告在线



主要技术指标

垂直定位和负载电机驱动	最大垂直行程	100mm
	定位精度	0.02 mm
	速率	0.1 ~ 10mm/s
水平定位与驱动电机驱动	最大水平行程	75mm
	定位精度	0.02 mm
	速率	0.1 ~ 10mm/s
上部旋转驱动	转速	0.1 ~ 500rpm
	最大负载	400N
下部旋转驱动	转速	0.1 ~ 500rpm
	最大负载	400N
额定负载和摩擦力传感器	量程	4 ~ 400N
	精度	0.4N
温度测量	测量范围	-50°C ~ +100°C
试样规格	上试样	φ100mm、φ150mm、φ200mm盘
	下试样	φ200mm 盘
供电及功率		AC220V, 50Hz, 2kW

1) 技术性能指标数据请以实物为准或询问客户经理。
2) 可承接个性化定制业务